

表 D-1 :

台聯大奈科中心－預約系統使用申請表

姓 名		身 份 證 字 號	
性 別		出 生	年 月 日
服 務 單 位		學 校	
		科 系	系所： 年級：
連 絡 電 話		指 導 教 授 單 位 主 管	
<input type="checkbox"/> α -step		<input type="checkbox"/> Anodic Bonder	
<input type="checkbox"/> CO2 Cleaning		<input type="checkbox"/> DC-Sputter	
<input type="checkbox"/> Double-side mask aligner		<input type="checkbox"/> E-Gun evaporater	
<input type="checkbox"/> ICP		<input type="checkbox"/> LPCVD-Nitride (TYSTAR)	
<input type="checkbox"/> PECVD		<input type="checkbox"/> LPCVD-Polysilicon (TYSTAR)	
<input type="checkbox"/> Polymer Coating System		<input type="checkbox"/> RIE-10NR	<input type="checkbox"/> RIE-200L
<input type="checkbox"/> RF Sputter (ULVAC)		<input type="checkbox"/> TMAH 槽	
<input type="checkbox"/> XeF2		<input type="checkbox"/> Alloy	
<input type="checkbox"/> Anneal		<input type="checkbox"/> APCVD	
<input type="checkbox"/> Boron Diffusion		<input type="checkbox"/> 化學站	
<input type="checkbox"/> NANOSPEC		<input type="checkbox"/> LPCVD-Polysilicon	
<input type="checkbox"/> POCL3 Diffusion		<input type="checkbox"/> LPCVD-Nitride	
<input type="checkbox"/> Photolithography		<input type="checkbox"/> RF Sputter	
<input type="checkbox"/> Thermal Oxidation			
備 註			

研究員簽章：